

供媒體即時發佈

投資者關係：
Ed Lockwood
Sr. Director, Investor Relations
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：
Meggan Powers
Sr. Director, Corporate Communications
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣佈其缺陷檢測與檢查系列設備增加新款產品 *電子束檢查結合光學檢測有助於迅速發現、識別和追蹤缺陷*

【加州 MILPITAS 2013 年 7 月 8 日訊】今天，[KLA-Tencor 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）宣佈，推出採用 [NanoPoint™](#) 技術的 2910 系列光學晶圓缺陷檢測平台和新型 eDR™-7100 電子束晶圓缺陷檢查系統。為了滿足積體電路製造商在先進設備上更快追蹤缺陷的需要，這兩款系統兼具快速和無縫接軌的優勢，能夠迅速發現和可靠識別影響良率的缺陷。透過偵測並成像位於 3D 或垂直結構（如 FinFET）底部的獨特缺陷，可以證明，2910 系列平台能夠改善缺陷擷取率，而 eDR-7100 系統則可提升檢查的解析度。

KLA-Tencor 公司晶圓檢測事業群的執行副總裁 Bobby Bell 表示：「我們客戶的製程提升需要運用複雜的圖案形成方式，這方面產生的缺陷挑戰促使我們在光學與電子束技術兩方面不斷創新。透過諸如我們的 [NanoPoint](#) 技術等新方法，我們不斷推進光學檢測。這些進步讓我們的 2910 系列產品達到了光學缺陷檢測的一個新境界，並且同時保持光學檢測速度。電子束技術的進一步發展讓我們的 eDR-7100 能夠精準識別極其微小的缺陷，這些缺陷在其他電子束檢查設備上則不一定可見。搭配使用這兩款設備可為我們的客戶提供高效的檢測與檢查解析度，以驗證領先的製程。」

KLA-Tencor 公司的 [NanoPoint](#) 專利技術獨具缺陷發現能力，2910 系列在此基礎之上，採用新的光圈與檢測模式，經證明，能夠大幅改善對良率至關重要的若干缺陷類型的捕獲率，例如空洞、短路和底部短路。此外，該設備與上世代的 2900 系列相比，其產能大幅提升，讓工程師能夠抽樣檢測更多晶圓，或檢測其他製程水準，更快識別良率問題。

eDR-7100 採用第四代電子束浸沒式光學元件，不僅提升了解析度，而且增加了影像模式，可針對不同缺陷類型進行成像。該設備還具有一項特殊功能，能夠在複雜圖案特徵或高縱橫比結構的底部尋找和識別缺陷。與 eDR-7000 相比，這些技術優勢可實現更高產能，讓工程師能夠抽樣檢測更多缺陷，更加精準地瞭解晶圓上的缺陷總體情況。由於積體電路晶圓廠越來越多地要求對諸如 [Surfscan® SP3](#) 等檢測儀所檢測的裸晶缺陷進行電子束檢查，因此 eDR-7100 配備了新型光學顯微鏡和 x 射線能譜儀 (EDX) 子系統，為裸晶缺陷的分類與成分分析提供協助。

領先的積體電路製造商已經安裝了多套 2910 系列光學檢測設備（配置為 2910 或 2915）和 eDR-7100 電子束檢查設備，用於發展新技術和提升產能。為了協助晶圓廠節省投資，2910

系列和 eDR-7100 設備可分別從其前身，2900 系列和 eDR-7000 升級。為了保持高效能和高產能，滿足最先進的生產需要，2910 系列和 eDR-7100 設備由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#) 提供支援。

關於 2910 系列光學檢測系統的更多資訊，請瀏覽 [2900 系列產品網頁](#)。關於 eDR-7100 電子束檢查設備的更多資訊，請瀏覽 [eDR-7000 系列產品網頁](#)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司是製程控管與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 eDR-7100 檢查設備、2910 系列檢測系統和 NanoPoint 技術的預期效能，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 eDR-7100 檢查設備、2910 系列設備和 NanoPoint 技術的預期使用，以及 eDR-7100 檢查設備、2910 系列設備和 NanoPoint 技術的使用者可以實現的預期成本、營運及其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###